



ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI - UOS di
Bologna

IL RESPONSABILE DELEGATO

- **VISTO** il d.lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02.05.2006 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 11, comma 10-bis lettera a) e l'art. 12;
- **VISTO** l'atto di delega di cui al protocollo n. 0002512 del 26/03/2014 a firma del direttore dell'IMM con il quale il responsabile dell'Unità Organizzativa e di Supporto (UOS) di Bologna è stato delegato ad indire una Gara ad evidenza europea nonché tutti gli atti ad essa connessi, presupposti e consequenziali;
- **VISTO** il bando di gara a procedura aperta per la fornitura e installazione di una apparecchiatura del tipo "SISTEMA PER LITOGRAFIA A CONTATTO NEAR-UV (ULTRA VIOLET) A DEEP UV (DUV) CON ALLINEAMENTO FRONTE E NANOIMPRINT ASSISTITO DA UV, UTILIZZABILE SU WAFER DA 4 POLLICI E ADATTABILE A WAFER DA 6 POLLICI" da destinare all'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR, UOS di Bologna, CIG 56983760A3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, serie S77 del 18 aprile 2014, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale, anno 155, numero 45, del 18 aprile 2014;
- **VISTI** i verbali della commissione giudicatrice nominata con provvedimento protocollo n.0004523 del 03/06/2014 attraverso i quali è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara in parola in favore della ditta Electron Mec S.r.l. corrente in Milano alla via Negroli 51/A;
- **VISTA** la richiesta, in atti protocollo n. 0004882 del 13/06/2014, inviata alla ditta Electron Mec S.r.l. con la quale è stata comunicata a quest'ultima l'aggiudicazione provvisoria in uno alla richiesta di documentazione integrativa al fine di procedere all'approvazione e conseguente aggiudicazione definitiva della gara *de qua*;
- **CONSIDERATO**, altresì, che la ditta Electron Mec S.r.l. ha fornito tutta la documentazione richiesta ai fini delle verifiche ex art.38 del D.-Lgs. 163/2006 ;
- **TENUTO CONTO**, che la documentazione richiesta alla ditta avallante SUSS Microtech Litography GmbH corrente in Garching b. Monaco pervenuta in data 02/07/2014 risulta correttamente prodotta in lingua tedesca e con traduzione giurata in lingua italiana;
- **VISTA** la legge 241/90 che stabilisce che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 2 del già citato d.lgs. 163/06 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- **RAVVISATA**, pertanto, l'opportunità di provvedere con celerità all'aggiudicazione definitiva della gara *de qua*



DISPONE

Per le motivazione riportate in premessa,

- a) l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per la fornitura e installazione di una apparecchiatura del tipo "SISTEMA PER LITOGRAFIA A CONTATTO NEAR-UV (ULTRA VIOLET) A DEEP UV (DUV) CON ALLINEAMENTO FRONTE E NANOIMPRINT ASSISTITO DA UV, UTILIZZABILE SU WAFER DA 4 POLLICI E ADATTABILE A WAFER DA 6 POLLICI" di cui al CIG 56983760A3 alla ditta Electron Mec S.r.l. corrente in Milano alla via Negroli 51/A per l'importo complessivo di € 276.000,00 (duecentosettantaseimila/00) oltre IVA come per legge.
- b) Subordinare l'efficacia del contratto di fornitura alla registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) La pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva secondo le modalità indicate dalla normativa vigente e dai regolamenti CNR.

Bologna, 04 luglio 2014

IMM - CNR - IMM	
Tit.	Cl. F:
N. 0005452	04/07/2014



Il responsabile delegato
Ing. Gian Carlo Cardinali